【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成21年6月18日(2009.6.18)

【公表番号】特表2005-508020(P2005-508020A)
【公表日】平成17年3月24日(2005.3.24)
【年通号数】公開・登録公報2005-012
【出願番号】特願2003-540708(P2003-540708)
【国際特許分類】
Ｇ０２Ｂ　6/255　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０２Ｂ　6/24　３０１

【誤訳訂正書】
【提出日】平成21年4月13日(2009.4.13)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
光軸の周りに配置された導光ミクロ構造内に配置されたモードフィールドと、前記ミクロ構造を取り囲むジャケットとを備えた、ミクロ構造を有する、シリカからなる光ファイバの端部と、
光軸の周りに配置されたモードフィールドを備え、１５５０ｎｍの波長において、該モードフィールドの直径が前記ミクロ構造を有する光ファイバのモードフィールドの直径に等しい、シリカからなる光ファイバの端部と、
前記双方の光ファイバを接合する、前記両端部の融着部とを含み、
該融着部における光学的損失が１dB 未満であり、
前記ジャケットの半径方向の幅は、前記導光ミクロ構造の半径方向の幅の少なくとも１．６倍であり、
前記融着部が少なくとも２１０ＭＰａ（３０Kpsi）の引っ張り強度を有することを特徴とする光学的継ぎ接合部。
【請求項２】
前記光学的損失が０．３０dB 未満であることを特徴とする請求項１記載の光学的継ぎ接合部。
【請求項３】
前記ミクロ構造を有する光ファイバの前記ミクロ構造が、前記光軸と平行に配置された少なくとも１本の孔を備え、前記融着部の近傍における前記孔の断面の縮小度合が５０％未満であることを特徴とする請求項１または２記載の光学的継ぎ接合部。
【請求項４】
ジャケットによって取り囲まれた導光ミクロ構造を備えた、ミクロ構造を有する光ファイバの端部と、コアおよびクラッドを有してなる光ファイバの端部との間に少なくとも２１０ＭＰａ（３０Kpsi）の引っ張り強度を有する光学的継ぎ部を形成する方法であって、
前記双方の光ファイバの端部を対向関係に整列させ、
電気的に作動される融着接続機から８ｍＡと１２ｍＡとの間の電流でアークを発生させ、
前記双方の光ファイバの端部を０．２秒から０．４秒の範囲の期間、前記アークに曝し、

前記対向する光ファイバの端部同士を接近させて接触させ、接合部を形成し、
前記接合部を、０．４秒から０．６秒の範囲の期間、８ｍＡから１２ｍＡの範囲の電流で第２のアークに曝す、
各ステップを含むことを特徴とする光学的継ぎ部の形成方法。
【請求項５】
前記対向する光ファイバの端部同士を接触させる工程が、該対向する光ファイバの端部同士をオーバーラップ接触させるものであることを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項６】
前記ミクロ構造を有する光ファイバの前記ミクロ構造が、該ミクロ構造を有する光ファイバの光軸と平行に配置された少なくとも１本の孔を備えたものであり、前記接合部の近傍における前記孔の断面の縮小度合を５０％未満とすることを特徴とする請求項４または５記載の方法。
【請求項７】
前記ジャケットの半径方向の幅が、前記導光ミクロ構造の半径方向の幅の少なくとも１．６倍であることを特徴とする請求項４から６のいずれか１項記載の方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１５】
工程の第３ステップが図３Ｃに示されている。ここでは、融着接続機１８の動作を停止し、ファイバ１および３の終端２５ａ，２５ｂが接触位置に接近せしめられてスプライス接合部２７を形成する。このステップにおいては、終端２５ａ，２５ｂが、約６から１０μｍ、最も好ましくは約８μｍの距離ｄ２オーバーラップして接触する。第２ステップの直後にはファイバ１および３の終端２５ａ，２５ｂが可塑状態にあるので、かかる「オーバラップ」接触が可能である。